

Analyse von Topografie und Oberflächeneigenschaften

Einsatz

- Topografie-Untersuchungen
- Oberflächenstrukturierungen
- Oberflächeneigenschaften

Methode Rasterkraftmikroskopie

Messbereich bis 100 µm x 100 µm (lateral) und 20µm (axial)

Grenzen axial bis 3 nm, lateral bis 10 nm (abhängig von Sensor-Durchmesser)

Anwendungsbeispiele

- Charakterisierung von Papieroberflächen (Bsp. rechts: Topografie eines gestrichenen Offset-Papiers)
- Analyse von Oberflächenstrukturen von Pigmenten und Fasern
- Bestimmung von Adhäsionskräften und Elastizität mittels Kraft-Abstands-Kurven

